

走査型電子顕微鏡 (FE-SEM/EDX)

前処理重要



【サンプルについて】

1. 真空中でガスや液体を放出しないもの
2. 設置上限サイズφ200mm×高さ80mm
(観察可能領域 中央部φ71mm)

【主な仕様】

- ・分解能: 二次電子像1.2nm(30kV,WD5mm)
- ・電子銃: ZrO/Wショットキー
- ・加速電圧 0.5~30kV
(リターディング使用時0.1kV可能)
- ・検出器: 二次電子検出器(高真空Lower, Top/低真空), 反射電子検出器
- ・分析元素: Be~Am(分解能128eV)

【データ出力】

記録メディア

USB, CDR, DVDR

保存形式

Jpeg, Excel, Word等

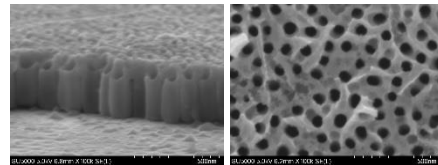
機種名

日立ハイテクノロジーズ SU5000
+EDAX Pegasus EDS/EBSP
2016年度購入

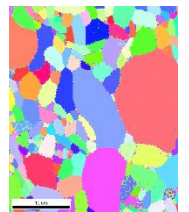
特徴

- 高真空/低真空モード切替可能
- 大口径70mm²シリコンナイトライドSDD検出器
- 元素分析, 線分析, 元素マッピングが可能
- EBSPによる結晶方位解析が可能
- 分析アプリケーションソフトウェア
 - ・TEAMソフトウェア
 - ・OIM Data Collection (EBSPデータ収集)
 - ・OIM Analysis (EBSPデータ処理)

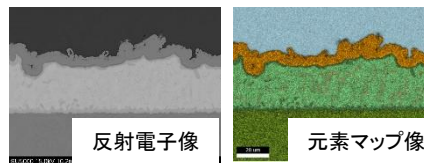
【観察例】



酸化チタンナノチューブの二次電子像



アルミナ焼結体の結晶方位解析



異種金属接合部の断面

料金等

- 機器使用: 4,000円/時
 操作法説明: 7,800円(2時間)
 表面観察: 7,300円/件(5万倍以下)
 8,500円/件(5万倍超過)
 定性分析: 8,500円/測定

※詳細についてはお問い合わせ下さい。

研究員による支援

3,900円 / 時

解析の支援

光軸, 非点補正補正, 撮影など

試料の前処理指導

切断, 研磨(450円/件),
埋込(750円/件)

ご利用申し込みは実施日の3日前まで可能です。